



**URZĄD
PATENTOWY
PRL**

Patent tymczasowy dodatkowy
do patentu nr ———

Zgłoszono: 20.09.79 (P. 218439)

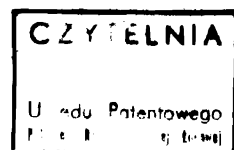
Pierwszeństwo ———

Zgłoszenie ogłoszono: 02.01.81

Opis patentowy opublikowano: 15.06.1984

Int. Cl.³ H03H 3/00

Opis patentowy
przedrukowano ze względu
na zauważone błędy



Twórcy wynalazku: Andrzej Kwiatkowski, Tadeusz Sieński, Andrzej Kucharczyk,
Tadeusz Lewicki, Klemens Endraszka, Bogusław Kaliszek

Uprawniony z patentu tymczasowego: Kombinat-Produkcyjno-Naukowy
Podzespołów Elektronicznych „UNITRA-ELPOD”
Zakład Podzespołów Radiowych „Omig”,
Warszawa (Polska)

**Urządzenie do przygotowania osłon,
zwłaszcza dla rezonatorów kwarcowych do montażu**

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do przygotowania osłon, zwłaszcza do rezonatorów do montażu.

Dotychczas przygotowanie osłon rezonatorów kwarcowych do montażu było realizowane na stanowiskach ręcznych, na których kolejno wykonywane wygniatanie, wgłębianie oraz zalutowywanie wgłębiania przez umieszczenie w nim kształtki z lutowni cynowo-ołowiowej podgrzewanej do temperatury topnienia lutowni, a następnie wykonywano w miejscu zalutowania otwór technologiczny przy użyciu wiertarki. Podawanie osłon na wiertarkę odbywało się automatycznie z podajnika wibracyjnego lub z kaset, które wcześniej napełniają się osłonami.

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia, w którym operacje wgłębiania, zalutowania tego wgłębiania oraz wykonanie otworu technologicznego odbywać się będzie w tymże urządzeniu.

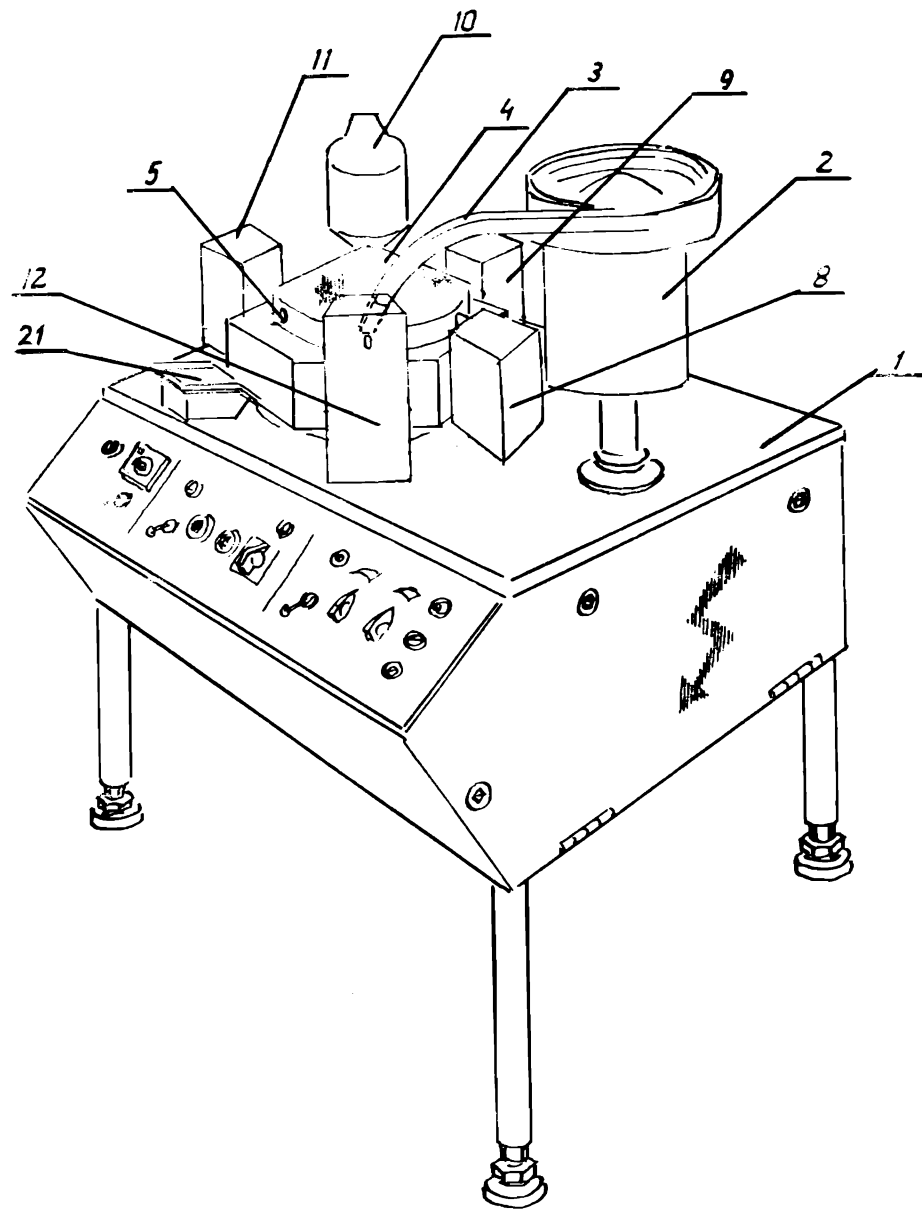
Cel ten został osiągnięty dzięki temu, że osłony z podajnika, ukształtowaną listwą jako zorientowaną przekazane są do mechanizmu podawania na belce obrotowego stolika obracającego się do mechanizmu podawania na belce obrotowego stolika obracającego się o założoną stałą wielkość, a następnie kolejno podawane są do mechanizmu wygniatania, mechanizmu topnikowania, mechanizmu podawania lutowni i lutowania, mechanizmu wykonującego otwór technologiczny, a następnie wyrzucane do pojemnika, przy czym mechanizm jak i pojemnik usytuowane są wokół stolika obrotowego na korpusie urządzenia. Korpus urządzenia wyposażony jest w podajnik osłon oraz w stół obrotowy z bolcami, wokół którego usytuowane są kolejno mechanizm podawania, wygniatania, topnikowania, mechanizmu lutowni i lutowania z grotem, mechanizm wykonujący otwór technologiczny w osłonie oraz pojemnik. Mechanizm podawania sprzężony jest z podajnikiem poprzez ukształtowaną listwę, zaś mechanizm topnikowania oraz podawania lutowni i lutowania zaopatrzone są w blokady, zaś poszczególne mechanizmy sterowane są krzywkami usytuowanymi na wałkach zespolonych poprzez przekładnię z silnikiem.

Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na przykładzie wykonania pokazanym na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie w rzucie perspektywicznym, fig. 2 — urządzenie w widoku z przodu, fig. 3 — urządzenie w widoku z boku fig. 4 — urządzenie w widoku z góry, fig. 5 — osłonę w częściowym osiowym przekroju, fig. 6 — osłonę w widoku z góry.

Na korpusie 1 urządzenia usytuowany jest podajnik 2 dla osłon 13 oraz stolik obrotowy 4 z bolcami 5. Wokół stolika obrotowego 4 usytuowane są kolejno mechanizm podawania 12, wygniatania 8, topnikowania 9, mechanizm lutowania i lutowania 10 z grotem 18, mechanizm 11 wykonujący otwór technologiczny 16 w osłonie 13 oraz pojemnik 21. Mechanizm podawania 12 sprzężony jest z podajnika 2 poprzez ukształtowaną listwę 3. Mechanizm topnikowania 9 oraz mechanizm lutowania i lutowania 10 zaopatrzone są w blokady 17. Poszczególne mechanizmy 12, 8, 10 11 sterowane są krzywkami 20 usytuowanymi na wałkach 19 w stoliku obrotowym 4 zespolonymi poprzez przekładnię 7 z silnikiem 6 w korpusie 1 urządzenia. Mechanizm lutowania 10 posiada podgrzewany oporowo ceramiczny grot 18. Osłony 13 uprzednio umieszczone w podajniku podawane są do mechanizmu podawania 12 na belce 5 obrotowego stolika 4 obracającego się o założoną stałą wielkość, a następnie kolejno podawane są do mechanizmu wygniatania 8, mechanizmu topnikowania 9, mechanizmu podawania lutowania i lutowania 10, mechanizmu 11 wykonującego otwór technologiczny 16 w osłonie 13. Osłony 13 następnie wyrzucane są do pojemnika 21 skąd są wybierane do dalszej obróbki.

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e

Urządzenie do przygotowywania osłon zwłaszcza dla rezonatorów kwarcowych do montażu, **znamiennie tym**, że korpus (1) urządzenia wyposażony jest w podajnik (2) osłon (13) oraz w stolik obrotowy (4) z bolcem (5), wokół którego usytuowane są kolejno mechanizm podawania (12), wygniatania (8), topnikowania (9), mechanizm lutowania i lutowania (10) z grotem (18), mechanizm (11) wykonujący otwór technologiczny (16) w osłonie (13) oraz pojemnik (21), przy czym mechanizm podawania (12) sprzężony jest z podajnikiem (2) poprzez ukształtowaną listwę (3) zaś mechanizm topnikowania (9) oraz podawania lutowania i lutowania (10) zaopatrzone są w blokady (17), zaś poszczególne mechanizmy sterowane są krzywkami (20) usytuowanymi na wałkach (19) zespolonych poprzez przekładnię (7) z silnikiem (6).

*fig. 1*

